



VES-10 形

マルチ成膜装置

カーボン蒸着・金属スパッタ・親水処理の 3 機能

- 2チャンバー、3種処理機能を搭載した電子顕微鏡向け複合前処理装置です。
- 弊社でも最も需要の多い VC-300S・MSP-1S・PIB-10 がこれ1台で OK。
- 自動プログラムにより、フルオート処理やインターロック機能を充実しました。
- 床置き 50ℓ/min RP を採用。振動・共振への配慮とメンテナンスし易さを考慮しました。
- チャンバーは2系統共に真空保持が可能です。
- カーボン蒸着電極の 2 対化(オプション)で FIB 用保護膜の作成にも応用可能。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel; 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特徴・仕様

特徴

- ★ この装置は、2つの試料処理チャンバーを持つ多目的簡易操作型カーボン蒸着、マグネットロンスパッタ成膜、親水処理機能を有する装置です。
- ★ 床置きロータリーポンプ(1mホース付)による排気で、オートリーク機能搭載。
- ★ 1台で当社製 VC-300S・MSP-1S・PIB-10 3機種の機能を有します。
- ★ 小形省スペース・多機能・簡易操作を製品コンセプトに、初心者でも安心です。
- ★ カーボン蒸着はシャープペンシル型カーボンを使用。固定電圧を2段切替。
- ★ マグネットロンスパッタ成膜、親水処理はフルオート処理。操作はタイマー調整のみ

仕様

1) カーボン蒸着

- * 替え芯型カーボン専用蒸着装置
- * カーボン整形不要、誰でも簡単操作
- * ガス出しに OUT-GAS(5V)、蒸着に EVAPO(15V)の2段切替。
- * 電圧固定式なので、複数人の使用でも再現性の高い蒸着が可能です。

2) イオンコーティング

- * 直流電圧並行平板型マグネットロン電極方式で、低電圧コーティングを実現。
- * ターゲット: Au, Pt, Au-Pd, Pt-Pd, Pd, Ag 使用可能 50mmΦ
- * 放電電源: DC500V 固定、0~50mA(可変抵抗器による微調整)
- * ターゲット/試料間隔: 35mm 固定
- * コーティング面内膜厚ムラ: 5%以内(Φ 50mm)、40%以内(Φ 74mm)
- * 試料台サイズ: 50mmΦ アノード電極分離フローティング方式
- * タイマー: オムロン社製電子タイマー
- * 雰囲気ガス導入: 圧力調整・導入管は装備しておりません。

3) 親水処理

- * イオンコーティング側のオートプロセススイッチを押すだけです。
- * 放電電源: HYD(S) AC450V 10~20mA / HYD(H) AC550V 20~30mA
- * TEM用支持膜の親水化、ダイヤモンドナイフのクリーニングなどに使用。
- * 電極サイズ: 50mmΦ、アルミ製

4) 装置仕様

- * 装置サイズ: W400xD356xH465mm 装置重量: 29kg
- * ロータリーポンプ: 床置き型。(SUS製フレキシブルホース1m付属) 重量: 14.6kg
- * 電源: AC100V(単相100V15A)アース付き3Pプラグ 1口

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。